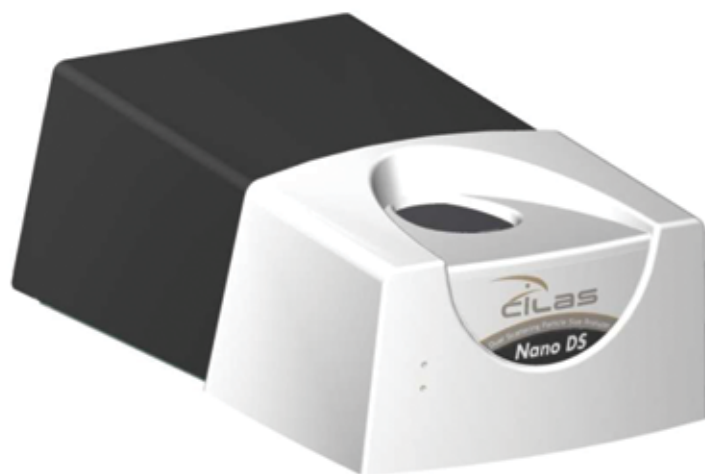


シーラス社（仏）

静的・動的光散乱式 マルチアングル対応 ナノ粉末粒度分布測定装置 「Nano DS」



レーザー回折・散乱式粒度分布測定装置のパイオニア・シーラス社（仏）は、動的光散乱式（DLS）と静的光散乱式（SLS）の2つの方式を一つの光学系システムに統合した、革新的なナノ粒子粒度分布測定装置を開発しました。

従来の動的光散乱式粒度分布測定装置では、散乱光の検出器が固定式になっており、シングルナノ粉末や多分散性、また高濃度などの多様なサンプルの粒度分布測定に十分対応できないケースがありました。シーラス社の「Nano DS」は、**検出器の角度を10°～150°の間で設定（1°刻み）**することができ、サンプルごとの適した角度で測定することでより精度の高い測定結果を得られます。



また、シーラス社の「Nano DS」では、DLSと同じレーザーと検出器を使用して静的光散乱式（SLS）での測定も可能です。ブラウン運動をしないような大きな粒子（600nm以上）の粒度分布測定に適しています。

主な特徴

- ・ 検出器の角度を調整でき、最適な角度で測定可能（マルチアングル）
- ・ DLSとSLSを一台の装置測定可能（部品交換不要）
- ・ 0.3～10ミクロンの広い測定範囲に対応

連絡先： シーラス社国内総代理店 株式会社ニューメタルスエンドケミカルスコーポレーション

東京本社 〒104-0031 東京都中央区京橋1-2-5 京橋TDビル5F

機械部 小熊 TEL：03-5202-5619 Eメール：oguma@newmetals.co.jp

大阪支店 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル

機械部 谷野 TEL：06-6202-5108 Eメール：tanino@newmetals.co.jp

YOUR PARTNER IN PARTICLE ANALYSIS

※仕様は予告なく変更することがございます。

The ultimate in nanoparticle characterization

www.cilas.com
info.particle@cilas.com

シーラス社製 静的・動的散乱式粒度分布測定装置

NanoDS 仕様一覧

	仕 様
測 定 範 囲	0.3nm — 10 μ m
試料濃度(%vol)	40%以下
測定再現性	1%以内
測定原理	静的(SLS) + 動的(DLS)マルチアングル光散乱式
散乱角度	10° (前方散乱) ~ 150° (後方散乱)、角度分解能0.01°
レーザー光源	レーザーダイオード 638nm - 25mW
試料量	3mL
検出器	高感度光子カウンター(PMTベース)
測定時間	30秒 - 60秒 (試料と測定手順によって変動)
測定温度	25°C
分散溶媒	水系及び有機溶剤系(ガラスキューベット)、プラスチックキューベット
操作環境温度	10 - 40°C
ウォームアップ時間	2分以下
解析ソフトウェア 「NanoExpert」	・キュムラント、Contin アルゴリズム使用 ・検出角度の設定(DLSのみ) ・データベース内蔵(SOPと測定結果) ・エクセルとPDFファイルへ出力
本体寸法	341mm(幅) x 218mm(高) x 533mm(奥)
本体重量	14.5kg
操作システム	メモリ: 4GB、インターフェイス: USB2.0(1ポート) OS: Windows7(32 & 64bits)、XP Professional(32bits)
電源	115V/60Hz - 230V/50Hz、60W
準拠規格	CFR21 part11、ISO13320と13321、ISO22412:2008
レーザー安全クラス	Class I、EN60825-1/:2008 & 21CFR-1040
電源規格	EMC: Directive 2004-108/EC Electrical Safety: directive 2006/95/EC
アクセサリ	USB2.0用ケーブル、NanoExpertインストール用CD-ROM、 ユーザマニュアル(英語・日本語)
シーラス標準粉末キット	NIST 100nm 球形ラテックス (定期的検査用)

※ 全てのパフォーマンスは、測定するサンプルによって異なります。
※ 仕様は予告なく変更されることがございます。

YOUR PARTNER IN PARTICLE ANALYSIS